最近の研究

電流-スピン流-熱流変換材料の現状と課題

1. はじめに

電荷の流れである電流とスピン角運動量の流れであるスピ ン流、この両者をいかに効率良く変換して利用するかが磁気 ランダムアクセスメモリ (Magnetic Random Access Memory; MRAM)や磁気センサ等のスピントロニクス素子の動作 の根幹を成しており、高効率な変換を可能にする材料の創製 が新たな機能性をもたらしてきた. 代表的なスピントロニク スデバイスである MRAM を例にとると, MRAM を構成す る磁気トンネル接合(Magnetic Tunnel Junction; MTJ)素子 にバイアス電圧を印加するとスピン偏極したトンネル電流が 流れる. MTJ は強磁性層/絶縁障壁層/強磁性層を基本構造 とし、強磁性層と絶縁障壁層の界面におけるスピン偏極率に 依存してトンネル電流のスピン偏極の度合いが決まる. つま り,スピン偏極率が電流-スピン流間の変換効率に相当し, フェルミ準位に片方のスピンバンドしか存在しないハーフメ タルなどの高スピン偏極材料を開発することができれば、2 つの強磁性層の磁化の相対角度によってトンネル抵抗が変化 するトンネル磁気抵抗(Tunnel Magnetoresistance; TMR)を 増大させ、MRAM の性能向上につながる⁽¹⁾.

TMR 効果や強磁性金属層/非磁性金属層/強磁性金属層に おける巨大磁気抵抗(Giant Magnetoresistance; GMR)効果 では,無偏極の電流が強磁性体やその接合界面を通してスピ ン偏極電流になることから,電流を伴うスピン角運動量の流 れ(スピン流)を創出していることになる.この電流を伴うス ピン流の他に,電流を伴わないスピン流も存在する⁽²⁾.一つ の例が非局所スピン注入という手法であり,上向きスピンの 流れ(J_1)と下向きスピンの流れ(J_1)が $J_1 = -J_1$ のとき正味の 電荷の流れはゼロになるがスピン流は $J_1 - (-J_1) \neq 0$ とな り,電流を伴わないスピン流が創出される⁽³⁾.これは純スピ ン流とも呼ばれる.スピン流は,次節で詳細に述べるスピン ホール効果(spin Hall effect; SHE)やスピン異常ホール効果 関 剛 斎*

(spin anomalous Hall effect; SAHE)によっても生成可能で ある. SHE や SAHE は物質中のスピン軌道相互作用を起源 とする電流-スピン流変換現象として位置付けられ,スピン オービトロニクスという新しい分野の基盤となる効果であ る⁽⁴⁾.

電流-スピン流変換とは別に、スピン流と熱流の変換、あるいはスピン流を介して電流と熱流の変換を取り扱う分野もスピンカロリトロニクスと呼ばれて注目を集めている⁽⁵⁾⁽⁶⁾. 2008年のスピンゼーベック効果の発見⁽⁷⁾を契機として勃興したスピンカロリトロニクスに刺激を受け、古くから知られている磁性体の熱電効果も再び脚光を浴びている.特に、強磁性体に温度勾配(∇T)をつけると磁化(M)と ∇T の外積方向に電圧(電場)が生じる異常ネルンスト効果(Anomalous Nernst Effect; ANE)は、磁性体を使った電流-熱流変換現象として注目を集めており⁽⁸⁾⁽⁹⁾、大きな ANE を示す材料の探索が盛んに進められている.

このように、近年のスピントロニクスでは電流-スピン流-熱流の相互変換がキーワードとなっており、それらを高効率 に変換できる材料の創製がスピントロニクスの更なる発展の ために必要不可欠となっている.本稿では、入力に対してそ の横方向に出力が得られる電流-スピン流-熱流の相互変換現 象について整理したのち、強磁性規則合金を用いた電流-ス ピン流変換、および磁性層を有する金属人工格子を用いた電 流-熱流変換について最近の我々の取り組みを紹介し、電流-スピン流-熱流変換材料の現状と課題について述べる.これ らの研究成果に関連して、日本金属学会・功績賞を受賞し、 まてりあに寄稿する機会を頂戴した.この場をお借りして関 係の先生方に心より御礼申し上げます.

2. 電流-スピン流-熱流の相互変換

図1に、電流-スピン流および電流-熱流の相互変換について代表的なものを整理した.図1(a)は電流(*J*_c)からスピン

2022年10月25日受理[doi:10.2320/materia.62.85]

^{*} 東北大学金属材料研究所;准教授(〒980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1) Recent Progress and Issues for Materials Enabling Interconversion between Electric Current, Spin Current, and Heat Current; Takeshi Seki(Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai) Keywords: *spin current, ordered alloy, spin Hall effect, anomalous Nernst effect, metallic superlattice*



図1 電流-スピン流および電流-熱流の相互変換. (a) スピン ホール効果と (b) 逆スピンホール効果. (c) 異常ホール 効果とそれによってスピン流が生じる (d) スピン異常 ホール効果. (e) 異常ネルンスト効果と (f) 異常エッチ ングスハウゼン効果.

流(**J**_S)へ変換する SHE であり,電流密度(**j**_C)とスピン流密 度(**j**_S)を用いて

$$\dot{\boldsymbol{j}}_{\mathrm{S}} = \left(\frac{\hbar}{2e}\right) \, \boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{SH}}(\boldsymbol{s} \times \boldsymbol{j}_{\mathrm{C}})$$
 (1)

の関係を持つ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾. ここで, eは素電荷, \hbar はディラック 定数, sはスピン量子化軸である. α_{SH} はスピンホール角と 呼ばれ, SHEによる電流-スピン流の変換効率となる. また, J_{C} は縦伝導率(σ_{xx})と電場(E)を用いて $J_{C} = \sigma_{xx} \cdot E$ となり, J_{S} はスピン化学ポテンシャルのシフト($\delta\mu$)の勾配に沿って 流れることから $J_{S} = -(\sigma_{xx}/e) \nabla \delta\mu$ と表せる. $J_{S} & x$ 方向, $J_{C} & y$ 方向として(ここでの座標の定義が図1(a)と異なっ ているので注意が必要である)伝導度テンソルをつかって J_{S} と $J_{C} & e$ 表すと

$$\begin{bmatrix} J_{s,x} \\ J_{c,y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & -\sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{xx} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\nabla_x \delta \mu/e \\ E_y \end{bmatrix}$$
(2)

となる⁽¹²⁾. SHE は伝導度テンソルの非対角項に対応し, σ_{xy} は $\alpha_{SH}\sigma_{xx}$ である. さらに式(2)からわかるように J_S から J_C への変換も可能であり, これが図 1(b)に示した SHE と相反 関係にある逆スピンホール効果(Inverse SHE; ISHE)である. SHE, ISHE ともに α_{SH} がキーパラメータであり, スピン軌 道相互作用の大きさが関係している. SHE および ISHE は Mに依らない効果であり, 2000年代後半からこれまで非磁 性材料を中心に様々な材料が研究され⁽¹³⁾⁻⁽¹⁷⁾, 最近では強 磁性材料や反強磁性材料にも研究対象が拡大している.

一方でMを有する強磁性体に J_c を流すと、図1(c)に示 すように、 $M \ge J_c$ の外積方向に異常ホール効果(anomalous Hall effect; AHE)によるホール電 $E(V_H)$ が生じる.すなわ ち AHE による横方向電流を J_c^{AHE} とし、強磁性体の局在ス ピンの偏極をpとすると、

$$\boldsymbol{J}_{\rm C}^{\rm AHE} = \boldsymbol{\alpha}_{\rm AH} \left(\boldsymbol{p} \times \boldsymbol{j}_{\rm C} \right) \tag{3}$$

となる. α_{AH} は異常ホール角である.ここで,強磁性体内部 においては J_C および AHE による横方向電流(J_C^{AHE})ともに スピン偏極していると考える(図 1(d)).AHE によって生じ るスピン流(J_S^{SAHE})は

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{S}}^{\mathrm{SAHE}} = \left(\frac{\hbar}{2e}\right) \left(\zeta - \boldsymbol{\beta}\right) \boldsymbol{\alpha}_{\mathrm{SH}} \left(\boldsymbol{p} \times \boldsymbol{j}_{\mathrm{C}}\right) \tag{4}$$

として表現でき、スピン異常ホール効果(SAHE)あるいは異 常スピンホール効果と呼ばれる⁽¹⁸⁾. ζ は J_{c}^{AHE} のスピン偏極 率、 β は縦方向電流のスピン偏極率である。横方向を開回路 とすると、 ζ のスピン偏極をもつ J_{c}^{AHE} と、反電場で駆動さ れた β のスピン偏極率をもつ反電流が打ち消しあうため、($\zeta - \beta$) α_{SH} が変換効率となる。これがスピン異常ホール角 (α_{SAH})である。SHE と SAHE の違いは AHE の対称性を満 足するか否か、言い換えるとMに依存するかどうかであ り、強磁性体では SHE と SAHE の寄与を分離して評価す る必要がある。

上記した SAHE 以外にも Mが関連する電流-スピン流の 変換プロセスが存在する.強磁性層/非磁性層界面での散乱 によってスピン歳差が誘起されスピン流を生成するプロセ ス⁽¹⁹⁾や、ノンコリニアな反強磁性体における磁気スピンホ ール効果⁽²⁰⁾、コリニアな反強磁性磁気構造における反強磁 性スピンホール効果⁽²¹⁾などが報告されており、どの変換プ ロセスが支配的なのかを判断するには、次節に具体例を示す ように $J_{\rm C} \ge M$ および生成される $J_{\rm S}$ の対称性に注意しなけ ればならない.

ここまでは電流-スピン流の相互変換について述べてきた が,磁性体における電流-熱流変換にも横方向に出力を取れ る現象がある.前節で述べた ANE による横方向電場(*E*^{ANE}) は

$$\boldsymbol{E}^{\text{ANE}} = S_{\text{ANE}} \left(\nabla T \times \boldsymbol{m} \right) \tag{5}$$

で与えられ(図1(e)), S_{ANE} は異常ネルンスト係数あるいは 横ゼーベック係数, mは磁化の単位ベクトルである.式 (5)が意味するところは,磁性体に温度勾配をつけること が入力となり,熱流の横方向に電圧の出力が得られる.この ANE にも相反効果が存在する.図1(f)に示すように,磁性 体に対して J_{C} を入力とすることで,異常エッチングスハウ ゼン効果(Anomalous Ettingshausen effect; AEE)により J_{C} とMの外積方向に温度勾配(∇T_{AEE})が生じる⁽²²⁾⁽²³⁾. ∇T_{AEE} は

$$\nabla T_{\text{AEE}} = (\boldsymbol{\sigma}/\kappa) \prod_{\text{AEE}} (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{m}) \tag{6}$$

となる. σ は電気伝導度, κ は熱伝導度, Π_{AEE} は異常エッ チングスハウゼン係数である. S_{ANE} と Π_{AEE} の間は Π_{AEE} = $S_{ANE}T$ の関係があり, ANE が大きい材料では効率良く熱を 電気に変換でき,一方で AEE を使うことで電気により磁性 体の加熱や冷却が可能となる.

以上のように α_{SH} , α_{SAH} および S_{ANE} はそれぞれ変換効率 そのものである.これらが大きな材料を探索するという目的 で取り組んだ研究の一例として,次節では L1₀型 FePt 規則 合金において観測された大きな $\alpha_{SAH}^{(24)}$ について紹介する.

3. 強磁性規則合金における電流-スピン流変換

(1) スピンホール効果とスピン異常ホール効果

強磁性体中の電流-スピン流変換のプロセスを正しく理解 するためには, Mに依存しない SHE と, Mに依存する SAHE などの複数の変換機構を分離して考え、厳密に定量 評価しなくてはならない.特に AHE を示す材料の場合には SAHE の寄与を無視する訳にはいかず,むしろ SAHE が主 要な機構となって高い電流-スピン流変換効率を期待するこ とができる. また, SAHE では強磁性体の M によって創出 される Js のスピン量子化軸が決まるという特徴がある.こ の特徴は応用上有用な機能性をもたらす. 電流-スピン流変 換を基盤とする応用技術として、スピン軌道トルク(Spin orbit torque; SOT) 磁化反転(図 2(a)) がある⁽²⁵⁾. SOT 磁化 反転は、スピン軌道相互作用に関係する現象を利用して Js を創出する非磁性体層と、創出された J_{S} を検出する (J_{S}) に よって磁化反転が誘起される)強磁性体層を積層させた二層 膜を中心に研究が進められている. ここで, 磁化に依存しな い SHE を起源とする J_s を使って垂直磁化膜の SOT 磁化反 転を実現しようとすると、通常 SOT に加え外部磁場を印加 しないと決定論的な磁化反転を実現できない⁽²⁶⁾.しかしな

> (a) MFerromagnet J_c Nonmagnet H_{ext} (b) M Ferromagnet (spin detector) Ferromagnet (spin-polarizer)

図2 (a) 強磁性層/非磁性層の二層構造においてスピンホー ル効果を使ったスピン軌道トルク(SOT)磁化反転.外 部磁場(H_{ext})を印加する必要がある.(b) スピン偏極用 の強磁性体と検出用の強磁性体の二層構造においてス ピン異常ホール効果を使った SOT 磁化反転. 無磁場下 で決定論的な磁化反転を実現できる. がら、SAHEの J_s を使うと無磁場下でのSOT磁化反転が可能となる⁽¹⁸⁾. SAHEを示す強磁性層の磁化が薄膜面内から立ち上がる(面直成分を有する)と、仰角成分がゼロでない pによって J_s がスピン偏極される.つまり、膜面垂直方向に流れる J_s のスピン量子化軸も膜面内から立ち上がることになり(図2(b))、 J_s の膜面垂直方向成分の存在により外部磁場の印加を必要としない無磁場SOT磁化反転を実現できる.これはSAHEを使う大きな利点である.では、SAHEを増大させる、つまり α_{SAH} を大きくするための指針はどうであろうか.式(4)から判断すると、AHEの大きな材料、さらには横方向電流のスピン偏極率と縦方向電流の差が顕著に大きい材料が有望となる.

(2) L1₀型 FePt 規則合金におけるスピン異常ホール効果

我々は SAHE の材料として、比較的大きな AHE を示す L1₀型 FePt 規則合金⁽²⁷⁾⁻⁽²⁸⁾(以下、L1₀-FePt と記す.)に着 目し、SAHE の定量評価に取り組んだ.後述するように、 L1₀-FePt の持つ大きな一軸磁気異方性を活用し、L1₀-FePt の磁化方向を制御することで SAHE と SHE の分離を行っ た⁽²⁴⁾.

図3(a)に用いた薄膜試料の模式図を示す.スパッタリン グ法を用いて,L1₀-FePt(30 nm) | Cu(3 nm) | Ni₈₁Fe₁₉(2 nm)のGMR構造をSrTiO₃(110)単結晶基板上にエピタキシ ャル成長させた.L1₀-FePtがSAHEによりJ₅を創出する



図3 (a) L1₀-FePt におけるスピン異常ホール効果を評価するための積層構造の模式図.(b) 電流(*J_C*)に対してFePt の磁化(*M*^{FePt})が直交する Orthogonal 配置および(c) *J_C* と*M*^{FePt}が平行となる Parallel 配置.(d) スピントルク強磁性共鳴測定のセットアップ.

スピン偏極層,そして Ni₈₁Fe₁₉ (Permalloy と呼ばれ,以下 では Py と記す)が SAHE による J_{s} を検出する層となる. ここで,L1₀-FePt 層は(110)面がエピタキシャル成長して おり,膜面内の[001]方向に強い一軸磁気異方性を示す面内 磁化膜となっている.一方で,Py はソフト磁性を示すた め,磁化(M^{Py})が外部磁場(H)方向に容易に揃う.この L1₀-FePt のハード磁性と Py のソフト磁性を上手く利用す ることで,電流に対して FePt の磁化(M^{FePt})が直交する Orthogonal 配置(図 3(b)),および電流と M^{FePt} が平行となる Parallel 配置(図 3(c))を実現できる.Orthogonal 配置は AHE の対称性を満足するが,Parallel 配置では AHE による 横方向電流は出現しない.したがって,両配置の結果を比較 することで SAHE とその他の変換機構の寄与を分離するこ とができる.

電流-スピン流変換の評価には,スピントルク強磁性共鳴 (Spin torque ferromagnetic resonance; ST-FMR) $^{(29)}$ を用い た.図3(d)にST-FMRの測定セットアップを示した.µm サイズの矩形状に微細加工した GMR 素子に対して、コプレ ーナ導波路形状の電極をもうけ、信号発生器から高周波電流 (I_{rf}) をGMR素子へと印加する.この I_{rf} はGMR素子の短 手方向に高周波磁場を発生させ、*I*_{rf}の周波数(f)が*J*_S検出 用の磁性層(本研究では Py 層)の磁気共鳴周波数と一致する 条件で磁化が大きく歳差運動する.磁気共鳴は GMR 素子の 抵抗(R)変化として現れ、時間的に変動するRと I_{rf} の積か ら, 直流電圧(V_{dc})が出現する. つまり, V_{dc} をHに対して プロットすることで Py 層の FMR スペクトルを得て,共鳴 磁場(H_{Res})や共鳴線幅(ΔH)を評価できる.ここで,直流電 流 (I_{dc}) を I_{rf} に重畳させると I_{dc} がもたらす J_S が新たに M^{Py} に作用し, Py 層の磁化ダイナミクスが変調を受ける.特に I_{dc} による ΔH の変化を調べることで、Py層に注入された $J_{\rm S}$ の量, すなわち $\alpha_{\rm SAH}$ や $\alpha_{\rm SH}$ を定量的に評価できる.

図 4(a) および 4(b) に Py 層の典型的な FMR スペクトル を示す. Orthogonal 配置の素子に対して I_{dc} = +4 mA およ $び-4 \, \text{mA} \, \varepsilon$ 印加した結果である. +4 mA 印加時の ΔH が -4mAと比較して広くなっている.この共鳴線幅の変化 は,正の*I*_{dc}で*M*^{Py}の磁気ダンピングが増加し,負の*I*_{dc}で 磁気ダンピングが低下していることを意味しており、L10-FePt によって生成された J_s が M^{Py} のダイナミクスを変調 している. このように Orthogonal 配置の素子では磁気ダン ピングの変化が観測され、L10-FePtにおいて電流-スピン流 変換が生じていることが確認できたが, Parallel 配置の素子 において同様の実験を行ったところ、*△H*の明瞭な変化は見 られなかった. Parallel 配置の素子は AHE の対称性を満足 しないため SAHE の発現は期待できず,存在するとすれば L10-FePtの磁化方向に依らないSHEによる電流-スピン流 変換である.しかしながら、Parallel 配置で磁化ダイナミク スの変調が生じなかった実験事実は、L10-FePtのSHEは 寄与が小さいことを示唆している.したがって、L10-FePt において支配的な電流-スピン流変換の機構は SAHE である と考えられる. 上記の Orthogonal 配置の素子で観測された



図4 L1₀-FePt(30 nm) | Cu(3 nm) | Ni₈₁Fe₁₉(2 nm)のGMR 構造におけるスピントルク強磁性共鳴スペクトル. Orthogonal 配置の素子に対して(a) +4 mA および(b) -4 mA の直流電流を印加した結果である. 白丸が測定 データ,実線が数値フィッティングの結果を表してい る. Ni₈₁Fe₁₉ 層(Py 層)の強磁性共鳴を検出しており, 灰色でハッチングした共鳴線幅が電流によってどのよ うに変化するかを評価した.

 ΔH の変化について, I_{dc} さらには外部磁場角度を変えなが ら系統的に調べることで α_{SAH} の値を見積もったところ, 0.25±0.03という非常に大きな値が得られた.この値は,他 の強磁性体でSAHE が報告されているCoFeB⁽³⁰⁾や非磁性 体のスピンホール材料として有名なPt⁽²⁹⁾⁽³¹⁾, Ta⁽²⁵⁾⁽³¹⁾, W⁽³¹⁾⁽³²⁾と比較しても同等かそれ以上の値であり,L1₀-FePt のSAHE は高効率な電流-スピン流変換を可能にするもので あることがわかる.

(3) 種々の電流-スピン流変換機構と課題

以上は L10-FePt の SAHE と SHE にフォーカスした研究 内容であるが、第2節でも述べたように、スピン歳差トル ク⁽¹⁹⁾や、磁気スピンホール効果⁽²⁰⁾、反強磁性スピンホール 効果⁽²¹⁾など SAHE 以外にも磁化が関係する様々な機構が提 案,そして実験的に観測されている. 各々の変換機構の理解 が進むと同時に、これらは複合して存在することが多々あ り、実際に観測される現象は複雑さが増している.単一の強 磁性金属層内における電流-スピン流変換だけに限定して も,表1に整理したように種々の材料において幾つかの対称 性を有する機構が様々な手法によって報告されてい る⁽³³⁾⁻⁽⁴⁰⁾. 我々のグループでは、単一の Py 層を有する薄膜 において界面での構造非対称性を利用することにより、電 流-スピン流変換が可能であることを示してきた⁽⁴¹⁾.ただ し、スピントルク発振を励起できるほどの高い変換効率には 達しておらず,狭窄構造において観測されている発振⁽⁴⁰⁾の 条件は明らかになっていないなど、十分な理解に至っていな い課題がまだまだある. また, L1₀-FePt の SAHE に関して

表1 単一の強磁性金属層における電流-スピン流変換の報告例.

材 料	観測された現象	観 測 手 法	文 献
Fe-Mn	AHE 起 源 の ス ピ ン 蓄 積	磁 気 抵 抗	33
Fe-Mn	界面でのスピン回転	ホール 電圧	34
Ni-Fe	SHE 様 な ス ピ ン 流 と 蓄 積	磁気光学効果	35
L1 ₀ -FePt	構造傾斜による有限な SHE	ホール 電圧	36
Ll ₀ -FePt	組成傾斜による有限な SHE	ホール 電圧	37
Co-Pt	横スピン流の生成	ホール 電 圧 /ST-FMR	38
Tb-Co	バルクスピン軌道相互作用	ホール 電圧	39
Ni-Fe	スピントルク発振	高周波測定	40

も、スピン異常ホール伝導度の理論計算値⁽⁴²⁾と実験値が一 致していないところもあり、引き続きの検討が必要とされ る.最近では、強磁性状態に転移することで非磁性状態より も電流-スピン流変換効率が向上することが見出され⁽⁴³⁾、強 磁性体を用いた変換プロセスが効率の観点でも有用であるこ とが示されている.複雑にからみあう現象を解きほぐし機構 の理解を深めることで、より高効率で機能的な強磁性体の変 換材料が実現されるものと期待したい.

4. 金属人工格子における電流-熱流変換

(1) 異常ネルンスト効果を用いた熱電変換の性能指数

前節では電流-スピン流変換について紹介してきた.本節 では,磁性体における電流-熱流変換について,特に金属人 工格子を用いた最近の研究を中心に説明する.2節で述べた ように,ANEは温度勾配と磁化の外積方向に横方向電場を 生じる現象であり,ゼーベック効果を動作原理とする従来素 子にはない新しい機能の熱電変換技術として注目を集めてい る.熱電変換の性能は,無次元性能指数ZTを用いて評価さ れることが多いが,ANEの場合には

$$ZT = (\sigma_v S_{ANF}^2 / \kappa_r) \cdot T \tag{7}$$

となる⁽⁴⁴⁾. ここで ∇T の方向を x 軸, E^{ANE} の方向を y 軸と し, κ_x は x 方向の熱伝導率, σ_y は y 方向の電気伝導率を表 している. ここで,一般的な値を入れて現状でどの程度の ZTが得られるのか見積もってみる.通常の金属では, $\kappa_x =$ $10~10^2$ W m⁻¹K⁻¹, $\sigma_y = 10^6~10^7$ S m⁻¹程度であり, S_{ANE} は 1 μ V K⁻¹を超えるような物質がいくつか発見されている が,室温での値は 10 μ V K⁻¹には到達していない⁽⁸⁾. これ らの典型的な値を使って見積もると, ZT は 10⁻³ 程度とな り,ゼーベック効果を動作原理とする従来素子には及ばない. ANE の応用に向けて,この性能改善は喫緊の課題である. ではどのようにすれば ZT を向上できるか.式(7)からわか るように, ANE の場合,熱伝導率と電気伝導率の方向が直 交していることが特徴である.この特徴に着目すると,磁性 体の伝導特性が異方的で κ_x を抑制しながら σ_y を高く保つこ とができれば, ZTの向上につながる.同時に, S_{ANE} が大 きい材料,すなわち電流-熱流変換効率が高い材料を探索することも不可欠となる.

(2) 金属人工格子における異常ネルンスト効果

熱電変換への応用を視野に入れた際の材料への要求や課題 を踏まえ,我々のグループでは金属人工格子の ANE に着目 して研究を進めている.金属人工格子とは異種金属をナノメ ートルスケールで積層制御した多層膜のことを指し、1980 年代から界面磁気異方性⁽⁴⁵⁾や層間交換結合⁽⁴⁶⁾,そして GMR⁽⁴⁷⁾⁽⁴⁸⁾といったスピントロニクスの礎となる研究トピ ックスの舞台となってきた物質群である.まず,積層構造で ある金属人工格子は界面の集合体と捉えることができ、界面 でのスピン軌道相互作用の増強によって磁気熱電効果も増強 することが期待できる.つぎに、金属人工格子の構造的な異 方性に着目すれば、 $\sigma_v \ge \kappa_x$ を独立に制御することも原理的 に可能となる.具体的には, M が膜面内の一方向にあり, 温度勾配が膜面垂直方向に印加される配置を考えると、面内 で磁化と直交する方向に ANE 電圧が生じる. このとき,温 度勾配が作られる膜面垂直方向は金属人工格子の積層方向で あり,界面散乱や周期構造を利用して κ_xを抑制できること が期待される.一方で、電圧を測定する面内方向の σ_v は比 較的高い値を維持することができるであろう.したがって, 金属人工格子の構造的異方性によって、電気伝導率と熱伝導 率の比が一定になるというヴィーデマン・フランツの法則か ら解放され、 $\sigma_v \ge \kappa_x$ を独立に制御する道筋が見えてくる. 以上より、金属人工格子は ANE を動作原理とする熱電変換 技術に有用な材料になりうる⁽⁴⁹⁾.

(3) Ni/Pt 金属人工格子

我々のグループはこれまでに、様々な材料の組み合わせの 金属人工格子において ANE を評価してきた. 2015年に報告 した Fe 系金属人工格子を用いた実験⁽⁵⁰⁾は、多層構造にお ける ANE の先駆的研究として位置付けられる. Fe/Pt, Fe/ CuおよびFe/Auの3種類の金属人工格子を研究対象と し、金属人工格子に特有の界面形成や多層構造化が ANE の 増強に対し有効に働くことが示された. この研究を発展さ せ,最近では Ni 系金属人工格子(51)や Co 基ホイスラー合金 を使った金属人工格子(52)へと物質を展開させている.図5 に Ni/Pt 金属人工格子における ANE の測定例を示す. この 実験で用いた Ni/Pt 金属人工格子では、3 nm 厚の Ni 層お よび 1 nm 厚の Pt 層ともに SrTiO₃(100) 単結晶基板上にエ ピタキシャル成長しており, 垂直磁気異方性を有する垂直磁 化膜である⁽⁵³⁾.図 5(a)は ANE の測定セットアップの模式 図、図 5(b) は ∇T によって誘導された横方向電場(E^{ANE} / ∇T)の外部垂直磁場(H)依存性である. ヒータによって基 板の一端を加熱、もう一端をヒートシンクとなる銅ブロック に接触させることで薄膜試料面内に温度差を付ける. 薄膜試 料面内の温度差は、サーモグラフィーによる熱画像とゼーベ ック電圧測定を組み合わせることで校正した.図5(b)に示 すように、 $E^{\text{ANE}}/\nabla T$ はHの掃引に対して磁化曲線を反映し



図5 (a) Ni/Pt 金属人工格子における異常ネルンスト効果を 測定するためのセットアップの模式図.(b) 温度勾配 ∇T によって誘導された横方向電場($E^{ANE}/\nabla T$)の外部 垂直磁場(H)依存性.Ni 層厚(t)を3 nm とした試料の 結果である.(c) 異常ネルンスト係数(S_{ANE})のt依存性. Ni バルクの報告値⁽⁵⁴⁾を点線で記した.(d) 横熱電伝導 率(α_{rv})のt依存性.

たヒステリシスを描いており,Ni/Pt エピタキシャル金属人 工格子の垂直磁化に由来したANEの電圧信号となってい る.このようにして得られた $E^{ANE}/\nabla T$ について, ∇T を系 統的に変えながら計測することで S_{ANE} を見積もった.図5 (c)に S_{ANE} のNi層厚(t)依存性をプロットした.t=1.5, 2.0,3.0および4.0 nm とした試料において,いずれも0.9 μ V K⁻¹以上の比較的大きな S_{ANE} を示しており,最も大きな値 はt=2.0 nm の $S_{ANE}=1.14\pm0.05 \mu$ V K⁻¹であった.比較の ために図5(c)中にNiバルクの報告値⁽⁵⁴⁾を点線で記したが, Ni バルクよりも一桁大きいANE が発現している.このこ とは,Ni と Pt という物質の組み合わせにおいても,金属人 工格子化がANE の増大に有効であることを示している⁽⁵¹⁾.

大きな ANE 発現の微視的メカニズムの詳細は文献(51)に 譲るが、ANE のプロセスをゼーベック効果によって駆動さ れた電流が AHE によって横方向電圧に変換されるプロセス と、熱流から横方向電流への直接変換のプロセスの二つに分 けて考えた場合、Ni/Pt 金属人工格子では後者のプロセスが 支配的であることが明らかとなっている. 直接変換のプロセ スのパラメータとなる横熱電伝導率 (α_{xy})は、図 5(d)に示す ように、1.5 nm $\leq t \leq 4.0$ nm の範囲においていずれも高い値 をとった. 特に t = 4.0 nm では $\alpha_{xy} = 4.8$ A K⁻¹ m⁻¹が得ら れた. この値は巨大な ANE が報告されている Co₂MnGa (2.4-3.0 A K⁻¹ m⁻¹)⁽⁵⁵⁾, Co₃Sn₂S₂ (~2 A K⁻¹ m⁻¹)⁽⁵⁶⁾, SmCo₅(4.6 A K⁻¹ m⁻¹)⁽⁵⁴⁾に匹敵するほど大きく、Ni 系金 属人工格子における ANE の増大の一因は高い α_{xy} にあるこ とが実験的に示された⁽⁵¹⁾.

(4) Co基ホイスラー合金を有する金属人工格子

Fe 系および Ni 系金属人工格子で得られた知見をもとに, 金属人工格子の構成要素として規則合金を用いることを試み



図6 熱酸化 Si 基板上に作製した AlN (20 nm) / [Co₂MnGa (12.5 nm) / AlN (5 nm)]_{x2} 薄膜の断面透過電子顕微鏡像.

た.本項では,強磁性物質自体が大きな SANE を示すことが 報告されている Co2MnGa⁽⁵⁵⁾⁽⁵⁷⁾(以下では CMG と記す)を 用い, CMG 層と窒化 Al 層との人工格子を形成すること で,多結晶で成長した CMG においても,単結晶と同等の大 きな ANE を発現できること⁽⁵²⁾を紹介する.本研究におい て窒化 Al 層を CMG との組み合わせに採用したのは,窒化 Al 層は熱処理に対して化学的に安定であり且つ急峻な界面 が得られ易いため,CMG の規則化のための熱処理プロセス を制限しないといった理由からである.また,窒化 Al 層は 絶縁性であるため金属同士の人工格子とはならないが,本稿 では金属磁性層を人工格子の要素とするものを広く金属人工 格子と称している.

まず,超高真空対応マグネトロンスパッタ装置を用いて, 熱酸化膜付きSi基板上にAlN(20nm)/[CMG(t_{CMG} nm)/ AlN(5nm)]_{xN}の積層構造を室温で成膜した.ここでCMG の層厚 t_{CMG} は,2.5,5,12.5および25nmと変化させ,繰り 返し回数Nは25/ t_{CMG} とした.CMGの合金組成はCo₅₂ Mn₂₂Ga₂₆である.成膜後に500°Cでアニールすることによ り,CMG層の規則化を促進した.図6に t_{CMG} =12.5nmと した試料の断面透過電子顕微鏡像を示す.500°Cでアニール した後の試料であるが目立った相互拡散は生じておらず,急 峻な界面が形成されていることがわかる.ここで界面での結 晶方位関係に着目すると,(110)_{CMG}||(0001)_{AlN},[001]_{CMG}|| [10-10]_{AlN}のエピタキシャル関係があり,エピタキシャル 歪みが導入されている.歪みの空間分布を調べたところ, CMG層内に均一にひずみが導入されていることがわかった.

このSi 基板上の試料について、熱輸送特性の t_{CMG} 依存性 を詳細に調べたところ、CMGの単結晶バルクや単結晶薄膜 に匹敵する大きな異常ネルンスト係数が発現すること(S_{ANE} = 4.9 μ V K⁻¹)、そしてその大きな ANE は歪み誘起のゼー ベック効果の増大がもたらしていることがわかった.これら の結果は、界面での歪みを活用することが CMG/AIN 超格 子構造の S_{ANE} を増大させる有効な方策の一つであるという ことを示唆している.



図7 (a) フレキシブル基板上に作製した AlN/Co₂MnGa 積層 構造を有する異常ネルンスト効果素子の写真および (b) 横方向電場(*E*^{ANE})の外部垂直磁場(*H*)依存性.

上記の結果における重要なポイントは、AIN と積層化さ せることで単結晶の CMG でなくとも、言い換えると単結晶 基板を用いなくとも、大きな ANE が得られることである. そこで、同様の構造をポリイミドのフレキシブル基板上に作 製し熱輸送特性を調べた. 図7(a)はフレキシブル基板上に 作製した折り曲げ可能な素子の写真である. AIN (20 nm)/ CMG (25 nm)/AIN (5 nm)の積層構造の薄膜を微細加工して 作製した. このフレキシブル素子における E^{ANE} の外部垂直 磁場(H)依存性を図7(b)に示す. CMG の磁気ヒステリシス を反映した電圧の磁場依存性が観測されており、 S_{ANE} は4.7 μ VK⁻¹ と見積もられた. このことから、CMG と AIN を組 み合わせた積層構造では、フレキシブル基板上においても高 い S_{ANE} を得ることが可能であり、エネルギーハーベスティ ング技術として不可欠なユビキタス性を満足するフレキシブ ル磁気熱電素子の候補になりうる⁽⁵²⁾.

5. まとめと今後の展望

本稿では、電流-スピン流-熱流変換材料の現状と課題と題 して、強磁性規則合金および金属人工格子を用いた最近の我 々の取り組みを中心に説明してきた.2000年代になってか ら、スピン角運動量の流れであるスピン流や、スピンを介し た準粒子間の相互変換を意味する「スピン変換」⁽⁵⁸⁾という概 念が生まれ、それらの物理的理解は飛躍的に進み、伴って興 味深い新現象が次々に報告されてきている.ではそれらを実 際にデバイスに応用しよう、と考えた時に必ずと言っていい ほど効率の問題がボトルネックとなる.本稿が対象とした α_{SH}, α_{SAH} および S_{ANE} は変換効率に相当し、これらが大きい 材料を見つけ出すことは応用研究を加速させるものであり大 変意義深い.勿論,応用を視野に入れた場合には他にも取り 組むべき課題が山積しているが,スピントロニクス分野にお いても新物質・新材料の研究がブレイクスルーをもたらし応 用につながった事例は多い.新しい高効率変換材料の発見 が,スピントロニクスを新たなステージへと牽引することを 期待したい.

本稿で紹介した研究内容は、東北大金研・高梨弘毅教授 (現・原子力機構先端基礎研センター長)をはじめとする磁性 材料学研究部門のメンバー、東北大通研・白井正文教授のグ ループ、東北大学際研・飯浜賢志助教、産総研・谷口知大 氏、物材機構・内田健一氏、桜庭裕弥氏および三浦良雄氏の 3名のグループリーダーと各グループのメンバーなど、多く の方との共同研究によって得られたものです.ここに関係各 位に感謝いたします.本研究の一部は、科研費・基盤研究 (S)(JP18H05246),基盤研究(A)(課題番号: JP20H00299)、村田学術振興財団の研究助成の支援のもと に遂行されました.

文 献

- B. Dieny, I. L. Prejbeanu, K. Garello, P. Gambardella, P. Freitas, R. Lehndorff, W. Raberg, U. Ebels, S. O. Demokritov, J. Akerman, A. Deac, P. Pirro, C. Adelmann, A. Anane and A. V. Chumak, *et al.*: Nat. Elec., **3**(2020), 446–459.
- (2) K. Takanashi: Jpn. J. Appl. Phys., 49(2010), 110001.
- (3) F. J. Jedema, A. T. Filip and B. J. van Wees: Nature, **410** (2001), 345–348.
- (4) X. Han, X. Wang, C. Wan, G. Yu and X. Lv: Appl. Phys. Lett., **118**(2021), 120502.
- (5) G. E. W. Bauer, E. Saitoh and B. J. van Wees: Nat. Mater., 11 (2012), 391–399.
- (6) S. R. Boona, R. C. Myers and J. P. Heremans: Energy Environ. Sci., 7(2014), 885–910.
- (7) K. Uchida, S. Takahashi, K. Harii, J. Ieda, W. Koshibae, K. Ando, S. Maekawa and E. Saitoh: Nature, 455(2008), 778– 781.
- (8) K. Uchida, W. Zhou and Y. Sakuraba: Appl. Phys. Lett., 118 (2021), 140504.
- (9)内田健一,関 剛斎:表面と真空,64(2021),562-567.
- (10) M. I. Dyakonov and V. I. Perel: Phys. Lett. A, 35(1971), 459– 460.
- (11) J. E. Hirsch: Phys. Rev. Lett., 83(1999), 1834-1837.
- (12) Concept in Spin Electronics (ed. S. Maekawa) Oxford University Press (2006).
- (13) A. Hoffman: IEEE Trans. Magn., 49(2013), 5172-5192.
- (14) J. Sinova, S. O. Valenzuela, J. Wunderlich, C. H. Back and T. Jungwirth: Rev. Mod. Phys., 87 (2015), 1213–1259.
- (15) H. Masuda, R. Modak, T. Seki, K. Uchida, Y.-C. Lau, Y. Sakuraba, R. Iguchi and K. Takanashi: Commun. Mater., 1 (2020), 75.
- (16) Y.-C. Lau, T. Seki and K. Takanashi: APL Mater., 9(2021), 081113.
- (17) K. Tang, Y.-C. Lau, K. Nawa, Z. Wen, Q. Xiang, H. Sukegawa, T. Seki, Y. Miura, K. Takanashi and S. Mitani: Phys. Rev. Research, 3(2021), 033101.
- (18) T. Taniguchi, J. Grollier and M. D. Stiles: Phys. Rev. Applied, 3(2015), 044001.
- (19) V. P. Amin and M. D. Stiles: Phys. Rev. B, 94(2016), 104419.
- (20) M. Kimata, H. Chen, K. Kondou, S. Sugimoto, P. K. Muduli, M. Ikhlas, Y. Omori, T. Tomita, A. H. MacDonald, S. Naka-

tsuji and Y. Otani: Nature 565 (2019), 627-630.

- (21) X. Chen, S. Shi, G. Shi, X. Fan, C. Song, X. Zhou, H. Bai, L. Liao, Y. Zhou, H. Zhang, A. Li, Y. Chen, X. Han, S. Jiang and Z. Zhu, *et al.*: Nat. Mater., **20**(2021), 800–804.
- (22) P. W. Bridgman: Phys. Rev., 24(1924), 644-651.
- (23) T. Seki, R. Iguchi, K. Takanashi and K. Uchida: Appl. Phys. Lett., **112**(2018), 152403.
- (24) T. Seki, S. Iihama, T. Taniguchi and K. Takanashi: Phys. Rev. B, **100** (2019), 144427.
- (25) L. Liu, C.-F. Pai, Y. Li, H. W. Tseng, D. C. Ralph and R. A. Buhrman: Science, **336**(2012), 555–558.
- (26) S. Fukami, T. Anekawa, C. Zhang and H. Ohno: Nat. Nanotech., 11(2016), 621–625.
- (27) P. He L. Ma, Z. Shi, G.Y. Guo, J.-G. Zheng, Y. Xin and S. M. Zhou: Phys. Rev. Lett., 109 (2012), 066402.
- (28) T. Seki, S. Kikushima and K. Takanashi: J. Magn. Soc. Jpn., 43(2019), 29–33.
- (29) L. Liu, T. Moriyama, D. C. Ralph and R. A. Buhrman: Phys. Rev. Lett., **106** (2011), 036601.
- (30) S. Iihama, T. Taniguchi, K. Yakushiji, A. Fukushima, Y. Shiota, S. Tsunegi, R. Hiramatsu, S. Yuasa, Y. Suzuki and H. Kubota: Nat. Elec., 1(2018), 120–123.
- (31) Y.-C. Lau and M. Hayashi: Jpn. J. Appl. Phys., 56(2017), 0802B5.
- (32) C.-F. Pai, L. Liu, Y. Li, H. W. Tseng, D. C. Ralph and R. A. Buhrman: Appl. Phys. Lett., **101** (2012), 122404.
- (33) Y. Yang, Z. Luo, H. Wu, Y. Xu, R.-W. Li, S. J. Pennycook, S. Zhang and Y. Wu: Nat. Commun., 9(2018), 2255.
- (34) Z. Luo, Q. Zhang, Y. Xu, Y. Yang, X. Zhang and Y. Wu: Phys. Rev. Applied, 11 (2019), 064021.
- (35) W. Wang, T. Wang, V. P. Amin, Y. Wang, A. Radhakrishnan, A. Davidson, S. R. Allen, T. J. Silva, H. Ohldag, D. Balzar, B. L. Zink, P. M. Haney, J. Q. Xiao, D. G. Cahill, V. O. Lorenz and X. Fan: Nat. Nanotechnol., 14(2019), 819–824.
- (36) M. Tang, K. Shen, S. Xu, H. Yang, S. Hu, W. Lü, C. Li, M. Li, Z. Yuan, S. J. Pennycook, K. Xia, A. Manchon, S. Zhou and X. Qiu: Adv. Mater., **32**(2020), 2002607.
- (37) L. Liu, J. Yu, R. González-Hernández, C. Li, J. Deng, W. Lin,
 C. Zhou, T. Zhou, J. Zhou, H. Wang, R. Guo, H. Y. Yoong, G.
 M. Chow, X. Han and B. Dupé: Phys. Rev. B, 101 (2020), 220402 (R).
- (38) L. Zhu, X. S. Zhang, D. A. Muller, D. C. Ralph and R. A. Buhrman: Adv. Funct. Mater., **30**(2020), 2005201.
- (39) J. W. Lee, J. Y. Park, J. M. Yuk and B.-G. Park: Phys. Rev. Applied, 13(2020), 044030.
- (40) M. Haidar, A. A. Awad, M. Dvornik, R. Khymyn, A. Houshang and J. Åkerman: Nat. Commun., 10 (2019), 2362.
- (41) T. Seki, Y.-C. Lau, S. Iihama and K. Takanashi: Phys. Rev. B, 104 (2021), 094430.
- (42) Y. Miura and K. Masuda: Phys. Rev. Mater., 5(2021), L101402.
- (43) T. Seki, Y.-C. Lau, J. Ikeda, K. Fujiwara, A. Ozawa, S.

Iihama, K. Nomura and A. Tsukazaki: (submitted).

- (44) Y. Sakuraba: Scri. Mater., **111**(2016), 29–32.
- (45) P. F. Carcia, A. D. Meinhaldt and A. Suna: Appl. Phys. Lett., 47(1985), 178–180.
- (46) P. Grünberg, R. Schreiber, Y. Pang, M. B. Brodsky and H. Sowers: Phys. Rev. Lett., 57 (1986), 2442–2445.
- (47) M. N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Etienne, G. Creuzet, A. Friederich and J. Chazelas: Phys. Rev. Lett., **61**(1988), 2472–2475.
- (48) G. Binasch, P. Grünberg, F. Saurenbach and W. Zinn: Phys. Rev. B, **39**(1989), 4828–4830(R).
- (49) 高梨弘毅, 関 剛斎:まぐね, 17(2022), 4-11.
- (50) K. Uchida, T. Kikkawa, T. Seki, T. Oyake, J. Shiomi, Z. Qiu, K. Takanashi and E. Saitoh: Phys. Rev. B, **92**(2015), 094414.
- (51) T. Seki, Y. Sakuraba, K. Masuda, A. Miura, M. Tsujikawa, K. Uchida, T. Kubota, Y. Miura, M. Shirai and K. Takanashi: Phys. Rev. B, **103**(2021), L020402.
- (52) J. Wang, Y.-C. Lau, W. Zhou, T. Seki, Y. Sakuraba, T. Kubota, K. Ito and K. Takanashi: Adv. Electron. Mater., 8 (2022), 2101380.
- (53) T. Seki, M. Tsujikawa, K. Ito, K. Uchida, H. Kurebayashi, M. Shirai and K. Takanashi: Phys. Rev. Mater., 4(2020), 064413.
- (54) A. Miura, H. Sepehri-Amin, K. Masuda, H. Tsuchiura, Y. Miura, R. Iguchi, Y. Sakuraba, J. Shiomi, K. Hono and K. Uchida: Appl. Phys. Lett., 115(2019), 222403.
- (55) A. Sakai, Y. P. Mizuta, A. A. Nugroho, R. Sihombing, T. Koretsune, M. Suzuki, N. Takemori, R. Ishii, D. Nishio-Hamane, R. Arita, P. Goswami and S. Nakatsuji: Nat. Phys., 14(2018), 1119–1124.
- (56) S. N. Guin, P. Vir, Y. Zhang, N. Kumar, S. J. Watzman, C. Fu, E. Liu, K. Manna, W. Schnelle, J. Gooth, C. Shekhar, Y. Sun and C. Felser: Adv. Mater., **31** (2019), 1806622.
- (57) K. Sumida, Y. Sakuraba, K. Masuda, T. Kono, M. Kakoki, K. Goto, W. Zhou, K. Miyamoto, Y. Miura, T. Okuda and A. Kimura: Commun. Mater., 1 (2020), 89.
- (58) Y. Otani, M. Shiraishi, A. Oiwa, E. Saitoh and S. Murakami: Nat. Phys., **13**(2017), 829–832.



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 2006年9月 東北大学大学院工学研究科博士課程修了 2006年10月 東北大学金属材料研究所・日本学術振興 会博士研究員,2007年4月東北大学金 属材料研究所・博士研究員,2008年4 月大阪大学大学院基礎工学研究科・日 本学術振興会博士研究員,2010年4月 東北大学金属材料研究所助教,2016年2 月より現職.

関 剛斎

専門分野:磁性材料学,スピントロニクス ◎スピントロニクスデバイスをはじめとする磁性体を 用いた素子の高性能化・多機能化を目指した材料の 開発,新機能の発現及び物性解明に従事.
